

日本学術振興会「結晶加工と評価技術」第145委員会
第111回委員総会議事次第

日時 2019年8月30日（金） 17:30～17:50
場所 明治大学駿河台キャンパス 大学会館第3、第4会議室

議題 1. 事務連絡
2. 委員動静・幹事構成について
3. 2018年度の決算と2019年度の予算報告について
4. 2019年度の研究会企画について
5. 2020年ハワイシンポジウムについて
6. その他

配付資料 1. 第9期委員名簿
2. 2018年度決算報告と2019年度予算報告

【今年度定例研究会予定】

(1) 第163回研究会「窒化物半導体中の欠陥評価の最近の進展（161と合同）」

期日，場所：2019.5月8日
明治大学紫紺館4階会議室
世話人：酒井、三宅、上田

(2) 第164回研究会「放射線を用いた先端計測技術：

— 見えない光でもものを見る、検出器開発から応用研究まで—」（委員総会開催）
期日，場所：2019年8月30日
明治大学駿河台キャンパス 大学会館第3、4会議室
世話人：志村、表、廣沢

(3) 第165回研究会「SiCの現状と問題点そして将来の展開等」

期日，場所：2019年11月13日
関西学院会館2Fレセプションホール（風の間）
世話人：大谷、西澤

(4) 第166回研究会「結晶薄化技術（仮題）」

期日，場所：2019年12月12日
明治大学駿河台キャンパス
世話人：佐野、閻

(5) 第167回研究会「シリコンフォトニクス関連（仮題）」

期日，場所：2020年1～2月開催を念頭に，未定
世話人：志村

【来年度主催国際会議予定】

(1) 会議名：2020年度ハワイシンポジウム

第8回 International Symposium on Advanced Science and Technology of Silicon Materials
期日，場所：2020年11月15日-19日
実行委員会委員長：末岡、プログラム委員長、西澤
Kona, Sheraton Hotel, Hawaii

(2) 会議名：DRIP-XIX

期日，場所：の開催予定は2021年度（10月頃）
実行委員会委員長：土田、関口
横浜かつくば

第145委員会のHP <http://www.riam.kyushu-u.ac.jp/nano/gakushin145/>